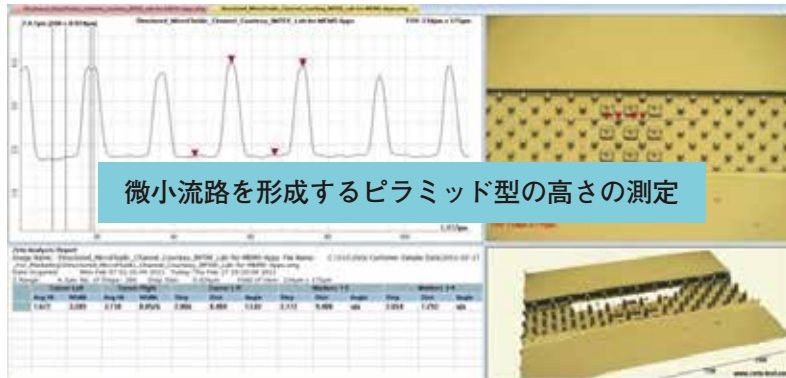


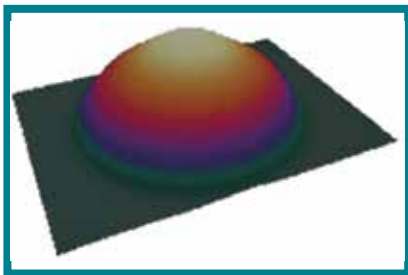
## ◆ マイクロデバイス



## マイクロ流体デバイス

マイクロ流体デバイスは、非常に少量の液体の制御を可能にする新たなデバイスです。シリコン、ガラス、ポリマーなどの材料で作られた微小流路や反応容器で構成される制御構造デバイスです。

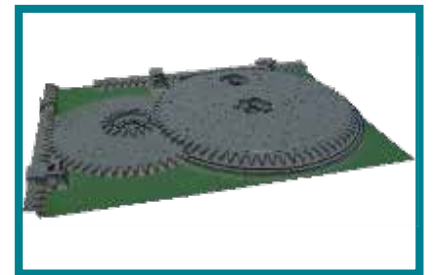
Zeta-20 は、デバイスの高さ、大きさを含む 3次元データを測定します。



マイクロレンズ

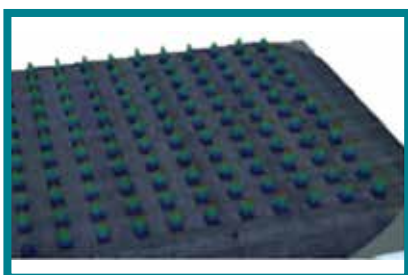


マイクロフローセパレーター



MEMSデバイス

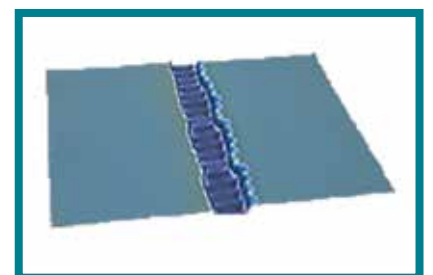
## ◆ 医療



マイクロニードル



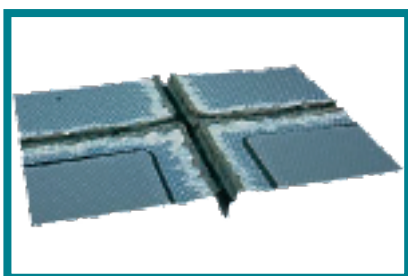
セルの電極



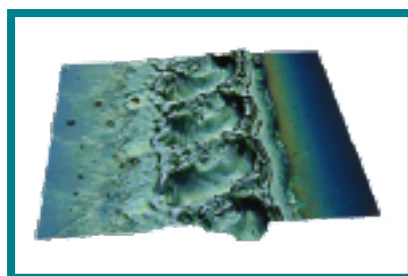
トレンチアイソレーション

## ◆ 太陽電池

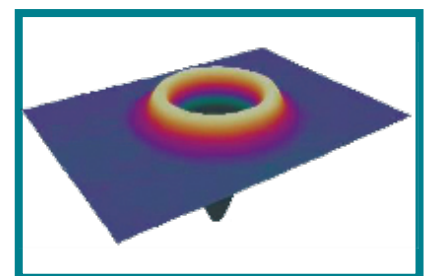
## ◆ 加工



レーザーダイシング



レーザーアブレーション



レーザーマーカ

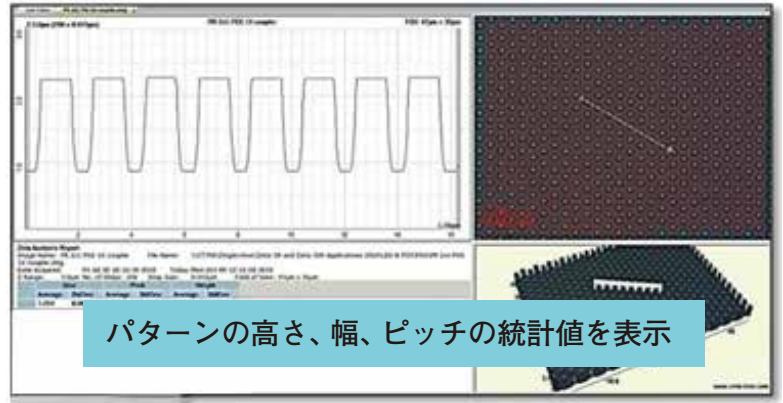
# LED

## パターン化サファイア基板

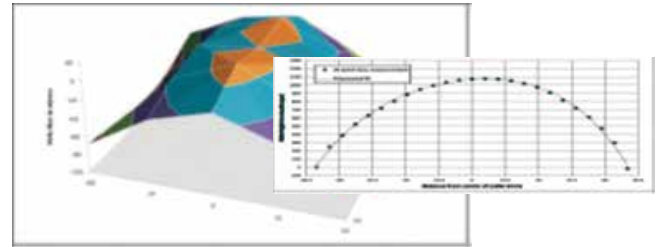
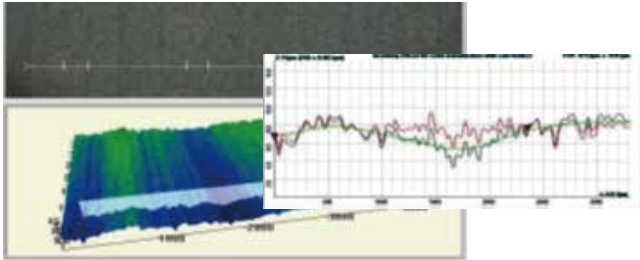
高輝度発光ダイオードの製造には、サファイアウエハ基板を使用します。

パターン化基板を使用することで光抽出効率を大幅に向上させます。

Zeta-PSS パッケージは、基板上的パターンの高さ、幅、ピッチを測定し、それらの平均、最大、最小などの統計データを表示します。



# 半 導 体

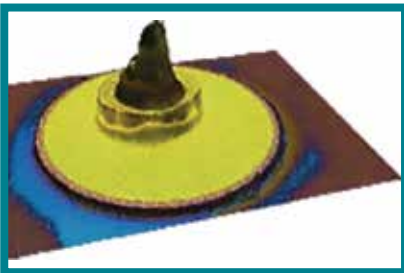


## ウエハーの測定

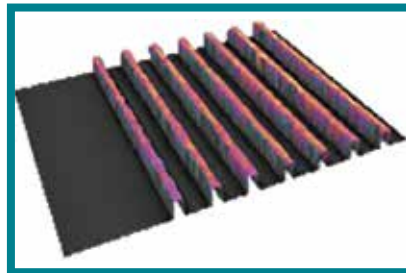
Zeta-20 は、レンズ倍率を使い分けることでウエハーの表面粗さやうねり、平坦度を測定します。

左図は、高倍率レンズを使用してウエハー表面の粗さとうねりを測定しています。

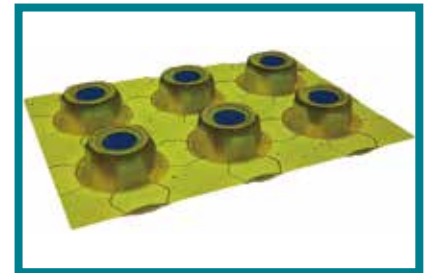
右図は、低倍率レンズを使用してウエハーの平坦度を測定しています。



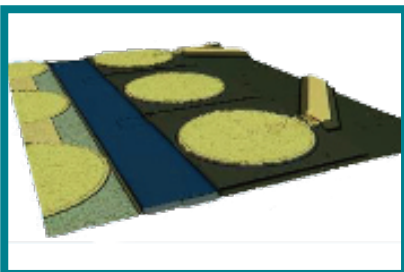
IC上のバンブ



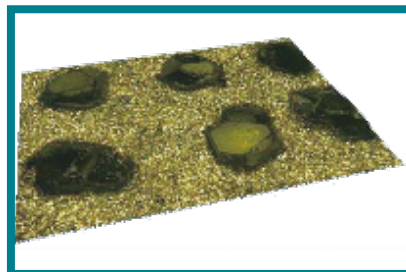
FOWLPの再配線



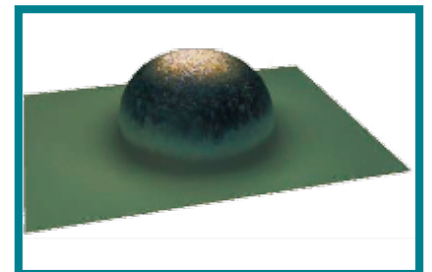
VCSELデバイス



IC回路



CMPパッドコンディショナー



FOWLPのバンブ

## フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル8階

info@filmetrics.co.jp www.filmetrics.co.jp

Tel 045-473-7109

Fax 045-473-7209